



LITHORIUM
MICROTECH

LITHORIUM MASK ALIGNER

LIMA-04 ve Lima06 litografi sistemi, yarıiletken aygıt üretimi için desenleme-litografi ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmış ve üretilmiştir.

Lima standart litografi uygulamalarına göre 4inch(Lima04) 6 inç(Lima06) wafer-altaş boyutundan 10x10mm'lik parça örnek hizalama desenlemesine uygun olarak tasarlanıp üretilmiştir.



Lima-04



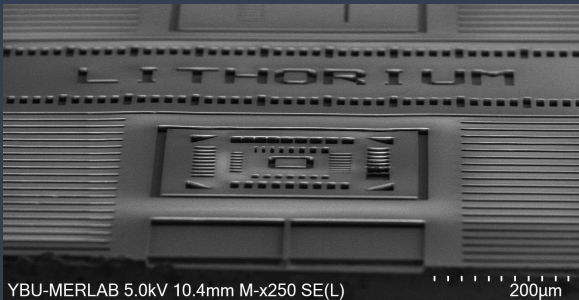
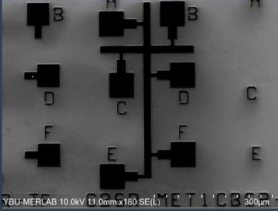
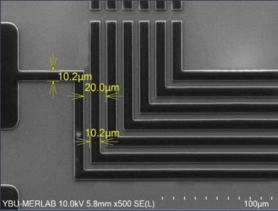
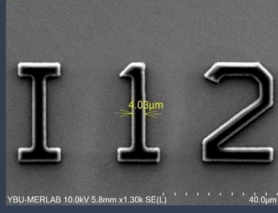
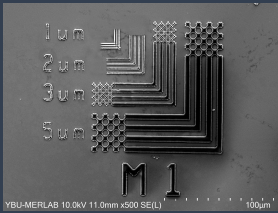
Lima-06

GENEL ÖZELLİKLER

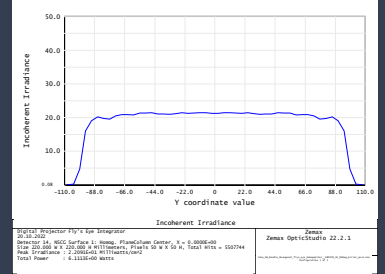
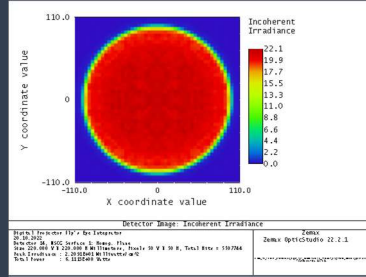
- Mikroskop ve Kamera ile hizalama seçenekleri
- Özel tasarlanmış homojen aydınlatma optik sistemi
- Joystick kullanımıyla yarı otomatik motorize hizalama
- 10mmx10mm örnek boyutundan 6 inç wafer'a kadar litografi işlemi
- Elektromekanik WEC sistemi
- Yumuşak sert kırılğan vs özellikli tüm alt taşlara uygundur

POZLAMA

- LİMA-04 veLima-06 ihtiyaçlara göre çeşitli pozlama seçenekleri ile çalışabilir.
- Soft, Hard ve Proximity(0-200um) modları ile ihtiyaç olunan çözünürlükte desenleme yapılmasına olanak sağlar.
- Lima-04-06 eski Hg lambalar yerine daha kompakt yapıya sahip UV-LED teknolojisini kullanır.
- Pozlama optikleriyle 160mmx160mm alan içerisinde <%3 homojenite gösterir.



YBU-MERLAB 5.0kV 10.4mm M-x250 SE(L)



Exposure Mode	UV400	UV300
Hard Contact	<2um	<1 um
Soft Contact	<3um	<2um
Proximity (25um)	<5um	<4um